

(11)Publication number:

04-161908

(43)Date of publication of application: 05.06.1992

_ 🧀 (51)Int.Cl.

- 3

GO2B GO2B 6/12

(21)Application number: 02-286729

(71)Applicant: HONDA MOTOR CO LTD

(22)Date of filing:

24.10.1990

(72)Inventor: HOSOI TAKASHI

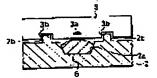
NISHIO TOMOYUKI KIMURA YOSHIHIKO

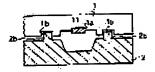
HATTORI HIROSHI

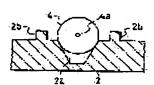
(54) OPTICAL IC CONNECTING DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To perform the positioning of an optical IC, a light emitting element and an optical fiber precisely and by forming a substrate by photograph etching, and providing recesses and projections for positioning the optical IC, light emitting element and optical fiber. CONSTITUTION: A positioning projection 2b formed by photograph etching is provided on a silicone substrate 2, and recesses 1b, 3b are provided on an optical IC 1 and a light emitting element 3 at positions corresponding to the projection 2b. The recesses 1b, 3b and the Vshaped groove 2a of the substrate 2 are formed by photograph etching. The optical IC 1, light emitting element 3 and optical fiber 4 are positioned by the recesses 1b, 3b, projection 2b and V-shaped groove 2a respectively, and they are fixed to the substrate 2 with an adhesive. The positioning of the optical IC 1, light emitting element 3 or optical fiber 4 can be performed precisely and, and the loss of optical bonding can be suppressed to the minimum.







LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

- 3

. Jr.

[Date of requesting appeal st examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]



Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本園特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

平4-161908

Sint. Cl. 5

- -

100

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)6月5日

G 02 B 6/42

6/12

7132-2K 7036-2K В

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全 4 頁)

光IC結合装置 の発明の名称

> 頤 平2-286729 ②特

平 2 (1990)10月24日 突出 顚

埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研究 陲 志 @発 明 者 稇 居 所内

埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研究 明 尾 友 行 個発 者 西 所内

埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研究 個発 明 者 村 芳 彦. 所内

埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研究 弘 @発 明 服 部 所内

東京都港区南青山2丁目1番1号 の出願 本田技研工業株式会社

個代·理 弁理士 渡部

月月 £EE

1. 発明の名称

光IC結合装置

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 光導波路の形成された光ICと、前記光導波路 の一端に光結合される発光素子と、前記光導波路 の少なくとも他の一端に光線合される光ファイバ と、前記光IC、発光業子及び光ファイバが装着 される基板とを有する光IC結合装置において、 前記基板は、写真鼓刻法にて形成され、前記光「 C、発光素子、及び光ファイバを位置決めするた めの凹部又は凸部を有することを特徴とする光「 C結合裝置。
 - 2. 前記光 I C、及び発光業子は前記基板凹部又は 凸部に対応する凸部又は凹部を有することを特徴 とする請求項1記載の光ⅠC結合装置。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は光10結合装置、例えば光ファイバジ

ヤイロのような光ICと光ファイバ及び光ICと 発光素子とが精密に結合された装置に関するもの である.

(従来の技術)

光ICと光ファイパとを接続する装置として、 第5図に示すように、シリコン基板2に位置合せ 用のV構2aを形成し、このV構2aに光ファイ パ4を配置して、光1C1の光導波路1aと光フ アイバ4とを光緒合させるようにしたものが従来 提案されている(特別昭59-185306公報)。 なお、第5回に斜線で示す部分7は、光ICの入 出力を行う電極配線を示す。

(発明が解決しようとする課題)

一般に光ファイバと光導波路との結合には1μα 以下の非常に高精度の位置合せが必要とされる。 しかしながら、上記従来の装置ではシリコン基板 に対する光ファイバの位置合せは高精度に行うこ とができるが、光ファイバに対する光1Cの位置 合せは高精度に行うことが困難であるという問題 があった。

4-161908 (2)

また、上記世来の装置では光ICの中に発光素子がモノリシックに形成されているが、現実には光ICに発光素子を形成するのは非常に困難な工程を必要とする。そのため、光ICと発光素子とを別個に設け、両者を光結合するのが現実的であるが、その場合には光ICと発光素子との位置合せも高精度に行う必要がある。

本発明は上述の点に無みてなされたものであり、 光IC、発光素子及び光ファイパの位置合せを高 精度に且つ簡便に行い、光結合の損失を最小限に 抑えることができる光IC結合装置を提供するこ とを目的とする。

(理測を解決するための手段)

上記目的を達成するため本発明は、光導液路の 形成された光1 C と、前記光導波路の一端に光結 合される発光素子と、前記光導波路の少なくとも 他の一端に光結合される光ファイバと、前記光1 C、発光素子及び光ファイバが装着される基板と を有する光1 C結合装置において、前記基板は、 写真触刺法にて形成され、前記光1 C、発光素子、

る。

光IC1の増面11には、第2図(b)に示すように光導波路1aの増配が電出しており、鉄塊配は同図(a)に示す発光素子3の光出射部3aと光結合されている。また光IC1の他の増面12にも、第3図(b)に示すように光導被路1aの増部が2ヵ所で露出しており(関図(b)には一方のみ示すが、他方も同様である)、これらの健和はそれぞれ同図(a)に示すように基板2のV字漢2aに配されている光ファイバ4のコア4aと光結合されている。

シリコン基板 2 には写真触刻法(マイクロマシーンニング法ともいう)により形成された位置合せ用凸部 2 b が設けられ、光I C 1 及び発光素子 3 には凸部 2 b に対応する位置にそれぞれ凹部 1 b 及び 3 b が設けられている。これらの凹部 1 b 、3 b 及び前記基板 2 の V 字標 2 a も写真触 刻法にて形成され、前記 V 字牒 2 a 、凸部 2 b 及び凹部 1 b 、3 b はいずれも 1 μ a 以下の位置精 皮を有する。

(2) 及び光ファイパを位置決めするための凹部又は凸部を有するようにしたものである。

また、前記光IC、及び発光素子は前記基板凹部又は凸部に対応する凸部又は凹部を有することが望ましい。

(作用)

写真触刺法により、凹部又は凸部の位置失めが高精度に行われる。その結果凹部又は凸部を一数させることにより、光ICと発光素子、及び光ICと光ファイパの位置合せを高精度且つ簡便に行うことができる。

(実施例)

以下本発明の一実施例を図面を用いて説明する。 第1図は本発明の一実施例に係る光ファイバジャイロの光Iで部分の構成を示す図である。同図中1は光ICであり、光IC1には、光導波路、偏光子、位相変調器、光検出器等がモノリシックに形成されている。光IC1は、前記光導波路、 億光子等の各要素が形成された面をシリコン基板 2に対向してこのシリコン基板2に接合されてい

光IC1、発光素子3及び光ファイバ4は、それぞれ前記凹部1b、3bと凸部2b、及びV字 漢2aによって位置合せされ、接着剤により基板 2に固着されている。従って、光IC1、発光素 子3及び光ファイバ4の相対的な位置合せを、1 μm以下の高い精度で簡便に行うことができる。 その結果発光素子と光ICとの光結合、及び光ファイバと光ICとの光結合の効率を向上させることができる。

なお、前記接着剤は硬化時の収縮性が少なく、 硬化後熱膨張の少ないシリコン系又はエポキシ系 のものを用いる。また、基板2には最初に発光素 子3を固着し、その後光IC1及び光ファイバ4 を固着するという手順が望ましい。最初に発光素 子3の動作チェックを行うことができ、生産性の 向上を図ることができるからである。

また発光素子3の一方の電極は、第2図(a) に示すように基板2のV字構2aに流し込まれた 準電性ペースト6を介して取り出し、他方の電極 は、表面からワイヤボンディングにより取り出す



ようにしている。

第4回を合わせて参照して、基板2の切り欠き 都X周辺の構造を説明する。

前述のように光IC1は、前記各要素(光導被路・偏光子等)の形成された面を下にし、この面をシリコン基板2に対向させて鉄基板2に固着されているため、シリコン基板2の光IC1の入工を観点を行っている。この切り欠き部Xに対向して映去されている。この切り欠き部Xに対向して、光IC1の裏面に接続され、前述の光IC1の入出力増于1cはワイヤボンディングにより配線基板5の電極増子5aに接続され、外部に引き出されている。従って、配線基板5上の配線パターンを介して光IC1への借号入力及び光IC1からの信号出力を行うことができる。

なお、本実施例では茎板2としてシリコン茎板 を用いたが、これに限るものではなく、シリコン 以外の半導体若しくは絶縁体を用いてもよい。

また、基板2の位置合せ用凸部は光ICと発光

I - I 線断面図、第 5 図は従来技術を説明するための図である。

1 …光IC、2 …基板、3 …免光素子、4 …光ファイバ、2 b …位置合せ用凸部、1 b, 3 b …位置合せ用凹部。

出廳人 本田技研工業株式会社

代理人 弁 選 士 液 部 敏 彦 岡 弁 理 士 木 内 毎 4-161908 (3)

(3) 菓子とで同一の寸法形状する必要はなく、別々の 寸法形状としてもよい。

また基板に凹部を形成し、光IC及び発光素子 に凸部を形成するようにしてもよい。

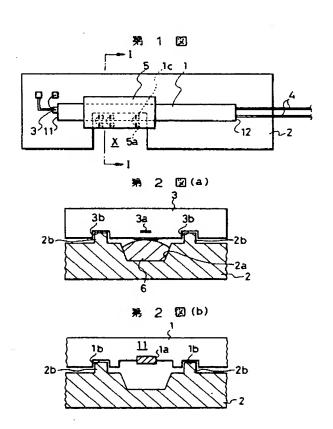
なお、第2図~第4図において位置合せ用凸部 と凹部との間に間隙があるように図示しているが、 これは説明のためであり、実際は関隙のない状態 で固着される。

(発明の効果)

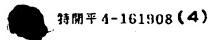
以上詳述したように本発明によれば、写真触刻 法によって形成された位置合せ用の凹部又は凸部 によって光ICと発光素子若しくは光ファイバと の位置合せを高精度且つ簡便に行うことができ、 光結合の損失を最小限に抑えることができる。

4. 図面の簡単な説明

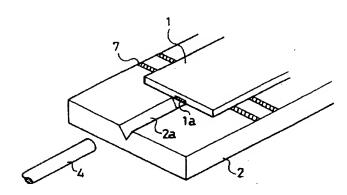
第1図は本発明の一実施例に係る光ファイパジャイロの光IC部分の構成を示す図、第2図は光ICの増面と発光素子との結合状態を説明するための図、第3図は光ICの増面と光ファイパとの結合状態を説明するための図、第4図は第1図の

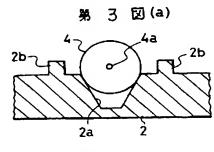


(4)

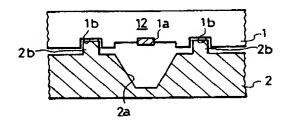








第 3 図(b)



3 4 ☑ 1 1c 5a